

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МНСТ

- Боброва Ю. С., Андроник М. М.** Методы нанесения толстых слоев жидких фотополимеров высокой вязкости 195
- Кульчицкий Н. А., Маянов Е. П., Наумов А. В.** Арсенид галлия и приборы нано-, микро- и оптоэлектроники на его основе 207
- Мустафаев Г. А., Мустафаева Д. Г., Мустафаев М. Г.** Влияние ионизирующих излучений на электрофизические свойства халькогенидов элементов первой группы 215
- Трофимов А. А.** Оптимизация толщины подложки приборных пластин сапфира и карбида кремния 219

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

- Афонин С. М.** Структурно-параметрические модели электромагнитоупругих актюаторов для нано- и микросистемной техники 227
- Садков В. Д., Фомина К. С.** Поглощающие элементы для реализации широкого диапазона ослаблений 238

ПРИМЕНЕНИЕ МНСТ

- Смолин В. К.** Использование микро- и нанотехнологий в производстве малогабаритных первичных источников электропитания 244

Аннотации и статьи на русском и английском языках доступны на сайте журнала (<http://microsystems.ru>; <http://novtex.ru/nmst/>) в разделе "Архив статей с 1999 г."